PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number :

05-154923

(43) Date of publication of application: 22.06.1993

(51) Int. CI.

B29C 65/78 B29C 65/48 B41F 17/14

GO2F 1/13

// B29L 31:34

(21) Application number: 03-323138

(71) Applicant : HITACHI LTD

HITACHI TECHNO ENG CO LTD

(22) Date of filing:

06.12.1991

(72) Inventor :

YONEDA FUKUO

ISHIDA SHIGERU

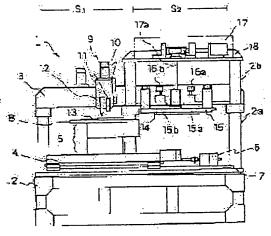
SANKAI .HARUO KONDO KATSUMI

(54) SUBSTRATE ASSEMBLING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a device, by which substrates can be pasted together with sealant with no introduction of dust during assembling work.

CONSTITUTION: A table 4, which travels between sealant drawing station S1 and substrate pasting station S2, is provided. Further, first substrate 13 is mounted on a stage 5, which travels on the table 4 normal to the travelling direction of the table 4, so as to emit sealant from an emitter, on which a downward directing nozzle tip is provided, and simultaneously move the stage to normal direction in order to draw pattern in S1. Second substrate 14 is horizontally hung with suction table 15 in S2. By moving the table 4 to S2, the first substrate is arranged below the second substrate. Finally, by narrowing the opposing interval between both the substrates, the substrates are pasted together.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-154923

(43) 公開日 平成5年(1993) 6月22日

(51) Int.Cl. 5 B 2 9 C 65/78 65/48	識別記号	庁内整理番号 2126-4F 2126-4F	F I	技術表示箇所
B41F 17/14 G02F 1/13	E 101	9112-2C 8806-2K		
# B 2 9 L 31:34		4 F	.	審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)
(21)出願番号	特願平3-323138		(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所
(22)出願日	平成3年(1991)12月	16日	(71)出願人	日立テクノエンジニアリング株式会社
		·	(72) 発明者	東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 米田 福男 茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所
			(74)代理人	内 弁理士 秋本 正実
				最終頁に続く

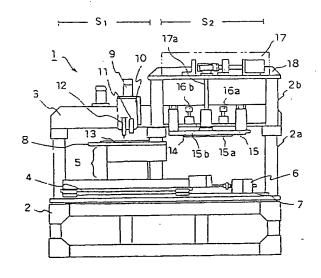
(54) 【発明の名称】 基板組立装置

(57)【耍約】

[目的] 組立作業中に塵埃を取り込まずに基板同士をシール剤で貼り合わせることのできる装置を提供すること。

【構成】 シール剤描画ステーションS1と基板貼り合わせステーションS2間を移動するテーブル4を設け、その上で直交方向に移動するステージ5に第1基板13を搭載し、S1でノズル先端を下方に向けて設けた吐出機12からシール剤を吐出させつつステージを直交方向に移動させてバターン描画し、S2で吸着テーブル15に第2基板14を水平吊下げ、テーブル4をS2に移動させて第1基板を第2基板の下方に配置し、両基板の対向間隔を狭めて貼り合わせる。

[図1] 本発明の一更批例にます液晶表示17礼組立装置 の正面図



[特許請求の範囲]

【請求項1】 シール剤描画ステーションと基板貼り合 わせステーションとの間を移動可能なテーブルと、上記 シール剤描画ステーションに設けられシール剤を吐出す る先端が下方を向いたノズルと、上記テーブル上に設け られ第1の基板を搭載する少なくとも直交方向に移動可 能なステージと、上記ノズルからシール剤を吐出させつ つ上記ステージを直交方向に移動させることにより上記 第1の基板にシール剤を所望のパターンで措画させる手 段と、上記テーブルが上記基板貼り合わせステーション 10 に移動されたときに第2の基板を上記ステージに搭載さ れた上記第1の基板と平行でその上方になるように支持 する手段と、上記支持する手段で平行に配置された上記 第1と第2の両基板の対向間隔を狭めることにより両基 板をシール剤で貼り合わせる手段とを備えたことを特徴 とする基板組立装置。

【請求項2】 請求項1記載の基板組立装置において、 上記ステージは搭載する第1の基板をさらに上下方向に 移動可能であることを特徴とする基板組立装置。

【請求項3】 請求項1記載の基板組立装置において、 その天井部と側周の一部とが網カバーで蔽われたことを 特徴とする基板組立芸置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は基板組立装置に係り、特 に液晶表示パネルのように2枚の基板を極めて接近させ 且つ組立作業中に塵埃を取り込まずに貼り合わすことが できる基板組立装置に関する。

[0002]

[従来の技術] 従来の液晶表示パネルは透明電極や薄膜 30 トランジスタアレイを付けた2枚のガラス基板を数μm 程度の極めて接近した間隔をもってシール剤で貼り合わ し、それによって形成される密閉空間に液晶を封止した ものである。この液晶表示パネルのシール剤をガラス基 板に設ける手段として、ノズルから基板上に抵抗ペース トを吐出させつつ基板を移動させることにより所定のパ ターンを描画させて抵抗パターンを設ける技術を利用す ることができ、このような従来技術として特開平2-5 2742号公報に記載のものがある。また従来の液晶表 示パネルの基板の組立にあたってはシール剤を設けたガ ラス基板を搬送手段で貼り合わせ作業台に移し、そこで 手作業で2枚のガラス基板の面方向の位置合わせを行っ てから、スペーサとなる粒子等をシール剤に含ませてお くことによって数μm程度の極めて接近した間隔に2枚 のガラス基板を貼り合わせていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術の液晶表 示パネルは微細な透明電極や薄膜トランジスタアレイが ガラス基板に設けられており、それによって構成される 画素は極めて小さいものである。したがって組立作業中 *50* しないため第1の基板上に塵埃が落下しないし、またシ

にガラス基板上に塵埃が積もって密閉空間に塵埃が取り 込まれると、その塵埃の存在する箇所は面素欠陥とな り、モノクロ表示パネルでは欠陥部が黒点となり、また カラー表示パネルでは欠陥部が赤・緑・青のいずれかの 色となって、画面に表示される映像が見にくいものとな る。この液晶表示パネルのシール剤をガラス基板に設け る手段として、上記特関平2-52742号公報に記載 のものを利用すると、そこでは基板とノズルが非接触の 状態で抵抗ペーストを吐出させ、基板を移動させて所定 の抵抗パターンを措画させており、ノズルを固定してい ることによって基板上に塵埃が積りにくいものとなって いる。しかしながら、ここでは抵抗パターン描画後の基 板の取扱いについては格別言及されていない。また従来 の液晶表示パネルの上記基板の組立にあたってはシール 剤を設けたガラス基板を搬送手段で貼り合わせ作業台に 移し、手作業で2枚のガラス基板の位置合わせを行って から貼り合わせているため、その組立作業中にガラス基 板上に塵埃が積もって、密閉空間に塵埃が取り込まれる 度合いが非常に高いという問題があった。

【0004】本発明の目的は上記従来技術の問題点を解 決し、液晶表示パネルのように基板にシール剤を設けた のち2枚の基板を極めて接近させて貼り合わせる組立作 業中に塵埃を取り込まずに貼り合わすことができる簡単 な構成の基板組立装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明の基板組立装置はシール剤描画ステーション と基板貼り合わせステーションとの間を移動可能なテー ブルと、上記シール剤描画ステーションに設けられシー ル剤を吐出する先端が下方を向いたノズルと、上記テー ブル上に設けられ第1の基板を搭載する少なくとも直交 方向に移動可能なステージと、上記ノズルからシール剤 を吐出させつつ上記ステージを直交方向に移動させるこ とにより上記第1の基板にシール剤を所望のパターンで 描画させる手段と、上記テーブルが上記基板貼り合わせ ステーションに移動されたときに第2の基板を上記ステ ージに搭載された上記第1の基板と平行でその上方にな るように支持する手段と、上記支持する手段で平行に配 置された上記第1と第2の両基板の対向間隔を狭めるこ とにより両基板をシール剤で貼り合わせる手段とを備え るようにしたものである。また上記基板組立装置におい て、上記ステージが搭載する第1の基板をさらに上下方 向に移動可能にしたものであり、また装置の天井部と側 周の一部が網カバーで函われるようにしたものである。

【作用】上記基板組立装置はシール剤描画ステーション で上記ノズルからシール剤を吐出させつつ上記ステージ を直交方向に移動させつつ第1の基板にシール剤パター ンを描画する工程で第1の基板の上部に動くものが存在

10

. 20

3

ール剤描画後に第1の基板がステージごと基板貼り合わ せステーションに移動して第2の基板の下方に配置され るため別の搬送手段が介在されないことと第1の基板の 上部で動くものが存在しないこととによって第1の基板 の移動する工程でも第1の基板上に塵埃が落下しない し、さらに両基板の貼り合わせ工程では上下で平行に配 置された両基板の対向間隔を狭めることにより両基板が 貼り合わされるため両基板の間に動くものが存在しない ことによって第1の基板上に塵埃が落下しないし、この ように組立作業の如何なる工程でも第1の基板上に塵埃 が落下しないため両基板のシール剤による貼り合わせで 形成される空間内に塵埃が取り込まれることがなく、装 置の構成も簡単にできる。また上記ステージは搭載する 第1の基板をさらに上下方向に移動させることが可能で あることにより装置構成をさらに簡単にすることが可能 であり、さらに装置の天井部と側周の一部は網カバーで 蔽われることによって装置をダウンフロー式クリーンル 一ムに置いて空気流で装置内の塵埃が外部に排出され る.

[0007]

[実施例] 以下に本発明の一実施例を図1から図3によ り説明する。図1は本発明による基板組立装置の一実施 例を示す液晶表示パネル組立装置の正面図である。図1 において、液晶表示パネル組立装置1はシール剤描画ス テーションS1と、基板貼り合わせステーションS2と の2部分から構成され、この両ステーションS1, S2 は隣接して並べられている。基台2の上方に支柱2 a で **梁持された架台3があり、基台2の上面には両ステーシ** ョンS1、S2に亘るレール?を備えている。このレー ル7上をステージ移動テーブル4がステージ駆動モータ 6 により、図面上で左右に即ち両ステーションS1. S 2間を移動できるようになっている。テーブル4上には XYθステージ5およびその上面で第1のガラス基板1 3を真空吸着などにより支持する下側吸着テーブル8が 載置されている。ここで $XY\theta$ ステージ5について説明 するに、第1のガラス基板13が水平に搭載されている とすると、第1のガラス基板13を水平にX軸・Y軸方 向に移動させるとともに、第1のガラス基板13を水平 に回転すなわち θ 軸移動させるものであり、もし第1の ガラス基板13がXY方向に正確に配置されるならばheta軸移動は不要である。

【0008】上記レール7と対面するシール剤描画ステーションS1部の架台3には2軸駆動モータ9によって上下に移動する2軸移動テーブル10が設けられている。このテーブル10には光学式非接触変位計11とノズルを持つシール剤吐出機12とが取付けられており、そのノズル先端は下方の第1のガラス基板13を向いている。一方の上記レール7と対面する基板貼り合わせステーションS2部の架台3の上部には、さらに支柱2bで染持された架台18に加圧用駆動機構17が報置さ 50

れ、その下方に延びたボールねじ17aを介して該駆動 機構17で架台3の下側に設けられた加圧吸着テーブル 15を上下に移動するようになっている。この加圧吸着 テープル15はその下面に第2のガラス基板14を上記 第1のガラス基板13と平行になるように真空吸着など により水平に吊り下げる形に支持するようになってい る。またこのテーブル15には2箇所に孔15a,15 bが穿けられており、このテーブル15に穿けられた孔 15a, 15bに対応する架台3の部署にはCCD内蔵 の画像認識用カメラ16a, 16bが取付けられてい る。この両カメラ16 a、16 bは下方を向いており、 従ってカメラ16a,16bはテープル15の両孔15 a、15bを通して第2のガラス基板14などの下部に 存在する物体を確認することができる。なおこの液晶表 示パネル組立装置には上記した各駆動部の図示していな い制御装置が設けられている。

【0009】図2は図1の液晶表示パネル組立装置の動 作説明用の概略図である。つぎに図2により図1の液晶 表示パネル組立装置の動作および機能を説明する。なお 図 2 では $XY\theta$ ステージ 5 および下側吸着テーブル 8 を 貼り合わせステーションS.2に移動させた場合を2点鎖 線で示し、その各々に50,80の符号を符した。図2 において、初めに貼り合わせステーションS 2 にステー ジ移動テーブル4が基台2上のレール7上を図1のステ ージ駆動モータ 6 により走行されると、 $XY \theta$ ステージ 5 φ上の下側吸着テーブル 8 φ上にアダプタ 1 4 α を介 して第2のガラス基板14が載置される。このアダプタ 14 a は第2のガラス基板14の下面が下側吸着テープ ル8φに接触することを阻止するためのもので、第2の ガラス基板14の周縁を支持する額縁状のものである。 ここで両カメラ16a.16bで第2のガラス基板14 に設けられた図示していない位置合わせマークを読み取 りつつ、第2のガラス基板14が貼り合わせステーショ ンS2の所定位置に置かれるように $XY\theta$ ステージ 5ϕ を制御する。次いで図1の加圧用駆動機構17で加圧吸 着テーブル15を下方に移動させて、第2のガラス基板 14を該テーブル15で水平に吊り下げる形に吸着支持 し、そのまま駆動機構17で加圧吸着テーブル15を介 して第2のガラス基板14を上方に移動させて待機さ せ、そしてアダプタ14aは除去される。この動作で塵 埃が遊離しても塵埃を避ける必要のない第2のガラス基 板14上面に落下するだけで何等の問題がない。

 $\{0\ 0\ 1\ 0\}$ 次に下側吸着テーブル 8 の上に第1 のガラス基板 $1\ 3$ が貼り合わせステーション $S\ 2$ の所定位置に置かれるように $XY\theta$ ステージ 5 のを制御する。ここで第1 のガラス基板 $1\ 3$ の位置合わせが終わったら、今度は $XY\theta$ ステージ 5 のをシール剤措画ステーション $S\ 1$ に移動させる。 次にシール剤措画ステーション $S\ 1$ で、2 軸移動テーブル $1\ 0$ 上の光学式非接触変位計 $1\ 1$ の出力により図 $1\ 0$

40

2 軸駆動モータ9を制御して、2 軸移動テーブル10上 のシール剤吐出機12のノズル先端と下側吸着テーブル 8上の第1のガラス基板13上面とのギャップを設定す る。この動作でギャップ設定のためのシール剤吐出機1 2のノズル移動距離はわずかであり、これによる塵埃の 遊離は殆どない。また塵埃の遊離を極度に嫌う場合に は、図2中に1点鎖線で示すようにシール剤吐出機12 の2軸移動テーブル10を含む駆動部を密閉し、その密 閉空間を真空引きすればよい。そしてXY&ステージ5 を所定の描画パターンに従ってXY方向に移動させつ つ、シール剤吐出機12のノズルからシール剤を吐出さ せて、シール剤の第1のガラス基板13への塗布を行 う。この描きたいシール剤パターンは図示していない。 また図示していない制御装置で所謂パソコン描画パター ンを格納記憶させておくことによって、同じ描画バター ンを何枚もの第1のガラス基板13への塗布を行うこと が可能であり、また格納データの変更で各種の描画パタ ーンを得ることもできる。この動作でシール剤の吐出描 画中に第1のガラス基板13の上部で動くものが存在し ないため、第1のガラス基板13の上面への塵埃の落下 はない.

【0011】次に該シール剤塗布終了後にXY B ステー ジ5は再び貼り合わせステーションS2に移動されて、 初めに第2のガラス基板14を抱えた加圧吸着テーブル 15の真下に位置決めされる。この動作でも第1のガラ ス基板13はXYθステージ5および下側吸着テーブル 8 ごと第2のガラス基板14の下方に配置され、別の搬 送手段が介在されないことと第1のガラス基板13の上 部で動くものが存在しないことによって、第1のガラス 基板13の移動に際しても第1のガラス基板13の上面 に塵埃が落下しない。さらに別の搬送手段を必要としな いので簡単な装置構成となっている。次に両力メラ16 a. 16bの焦点を第1のガラス基板13の図示してい ない位置合わせマークに合わせ、両カメラ16a, 16 らでマークを読み取りながらXYθステージ5φを駆動 制御して、第1のガラス基板13と第2のガラス基板1 4との凡その位置合わせを行う。そして図1の加圧用駆 動機構17で加圧吸着テーブル15を下方に徐々に移動 させて、両カメラ16a、16bで第2のガラス基板1 4の図示していない位置合わせマークが読み取れるよう になったら、 $XY\theta$ ステージ5 ϕ を駆動制御して第1の ガラス基板13と第2のガラス基板14との正確な位置 ・合わせを行いつつ、加圧吸着テーブル15をさらに徐々 に下降させて2枚のガラス基板13,14をシール剤で 貼り合わせる。この動作で両ガラス基板13,14の貼 り合わせでは、両ガラス基板13、14の間に動くもの が存在しないことによって、第1のガラス基板13の上 面に塵埃が落下しない。以上のように組立作業の如何な る工程でも第1のガラス基板13の上面に塵埃が落下し

り合わせで形成される空間内に塵埃が取り込まれること がない。また以上のシール剤描画工程と、基板貼り合わ せ工程と、そのシール剤描画と基板貼り合わせの両ステ ーション間の移動工程とは簡単なシーケンス制御で処理 できるので、図示していない制御装置により一連の動作 をプログラム化してパソコンで制御してもよい。

【0012】図3は図1の液晶表示パネル組立装置の外 観の斜視図である。図3において、図1の液晶表示パネ ル組立装置1の前面と裏面の下部には網カバー19,2 0が設けられ、両側面には蔽いカバー21, 22が設け られ、蔽いカバー22の脇に各駆動部の図示していない 制御装置の制御パネル23が設置されている。また天井 には網カバー24が設けられ、前面の上部にはアクリル 製の透明カバー25が設けられて内部が見えるようにな っている。本液晶表示パネル組立装置1はダウンフロー 式クリーンルームに置かれ、矢印Aで示した空気が流さ れると、装置1に天井の網カパー24から入った空気は 矢印B. Cで示すように装置1の前面と裏面の下部の網 カバー19,20から流出し、その空気流で装置1内の 塵埃は外部に排出される。

【0013】本基板組立装置は以下の態様で実施でき る。第1の態様は図1の2軸移動テーブル10に代えて 2軸移動テーブルをXY B ステージ5に設け、シール剤 描画ステーションS1部の架台3にノズルを持つシール 剤吐出機12および光学式非接触変位計11を直接固定 し、該2軸移動テーブルでシール剤吐出機12のノズル 先端と下側吸着テーブル8上の第1のガラス基板13と のギャップを設定するようにしたものである。この躯様 はシール剤措画ステーションS1では下側吸着テーブル 8に載置される第1の基板13の上方に可動部が全く存 在しないため、第1の基板13への塵埃の落下が皆無で ある。第2の態様は図1の基板貼り合わせステーション S2における加圧用駆動機構17および架台18を省略 し、架台3に第2の基板14の吸着テーブル15を直接 固定して、2軸移動テーブルを $XY\theta$ ステージ5に設 け、該2軸移動テーブルで第2の基板14を上昇させて 吸着テーブル15に吸着固定し、また3枚の基板13, 14を貼り合わせるようにしたものである。この態様は 基板貼り合わせステーションS2では吸着テーブル15 の上方に可動部が全く存在せず、塵埃の第1の基板13 への落下が皆無であり、また加圧用駆動機構17と架台 18の省略により装置構成が一層簡略化できる。第3の 銀様は基板吸着機能をXY θ ステージ 5 に設けて、下側 吸着テーブル8を省略したものである。この態様はステ ージ移動テーブル4上に乗せられる部材が減少して、軽 量化によりステージ移動テーブル4の走行が軽快にな る。第4の態様はシール剤の固定化仕様に応じて、シー ル剤固化のための紫外線照射手段等をシール剤描画ステ ーションS1と基板貼り合わせステーションS2のいず ないため、両ガラス基板13,14のシール剤による貼 50 れかに設けたものである。この態様はシール剤の固化の ための別置きの装置を必要とせず、装置構成を簡略化で きる。

(0014)

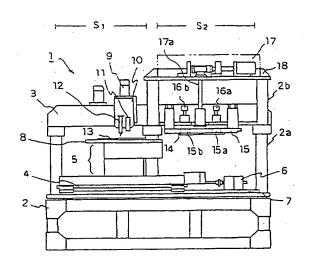
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、液 晶表示パネルのように2枚の基板を接近させてシール剤 で貼り合わせる基板組立装置での組立作業中に塵埃を取 り込まずに貼り合わすことができ、また基板組立芸置の 構成を簡単にできる効果がある。

【図面の簡単な説明】

示す液晶表示パネル組立装置の正面図

[図1]

[図1] 本窓明の一更施田を示す液晶を示けれ、組立模置 の正面図

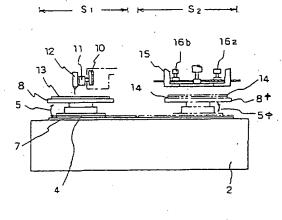


【図2】図2は図1の動作説明用の概略図 【図3】図3は図1の外観の斜視図 【符号の説明】

S1…シール剤描画ステーション、S2…基板貼り合わ せステーション、4…ステージ移動テーブル、5…XY θステージ、7…レール、8…下側吸着テーブル、10 … 2 軸移動テーブル、11…光学式非接触変位計、12 …ノズルを持つシール剤吐出機、13…第1の基板、1 4…第2の基板、15…加圧吸着テーブル、16a, 1 【図1】図1は本発明による基板組立装置の一実施例を 10 6 b … カメラ、17 … 加圧用駆動機構、19,20,2 4…網カバー。

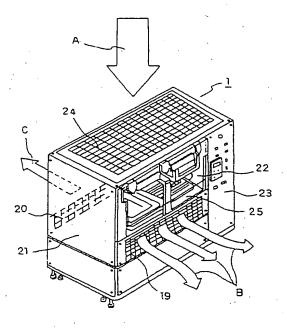
[図2]

[図2] 図1の動作説明用の概断图



[図3]

[図3] 図1a外観斜視図



フロントページの統き

(72)発明者 石田 茂

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72)発明者 三階 春夫

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所 内

(72)発明者 近藤 克己

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日 立製作所日立研究所内